

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年9月29日(29.09.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/201283 A1

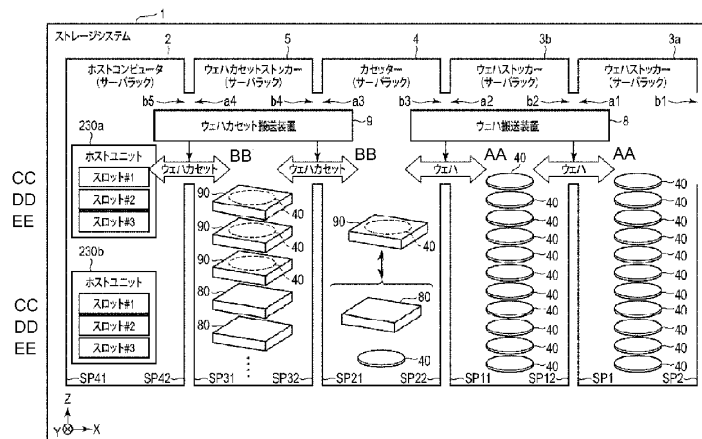
- (51) 国際特許分類:
G06F 12/00 (2006.01) G11C 5/04 (2006.01)
G06F 12/06 (2006.01) G11C 7/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/011856
- (22) 国際出願日: 2021年3月23日(23.03.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: キオクシア株式会社 (KIOXIA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1080023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 人見達郎 (HITOMI, Tatsuro); 〒1080023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 キオクシア株式会社内 Tokyo (JP). 吉水 康人

(YOSHIMIZU, Yasuhito); 〒1080023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 キオクシア株式会社内 Tokyo (JP). 井上新(INOUE, Arata); 〒1080023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 キオクシア株式会社内 Tokyo (JP). 堂前 宏之(DOHMAE, Hiroyuki); 〒1080023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 キオクシア株式会社内 Tokyo (JP). 早坂 一人(HAYASAKA, Kazuhito); 〒1080023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 キオクシア株式会社内 Tokyo (JP). 佐貫 朋也(SANUKI, Tomoya); 〒1080023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 キオクシア株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人スズエ国際特許事務所 (S & S INTERNATIONAL PPC); 〒1050001 東

(54) Title: STORAGE SYSTEM

(54) 発明の名称: ストレージシステム



- | | |
|--|------------------|
| 1 Storage system | 230a Host unit |
| 2 Host computer (server rack) | AAWafer |
| 3a, 3bWafer stocker (server rack) | BBWafer cassette |
| 4 Cassette (server rack) | CC Slot#1 |
| 5 Wafer cassette stocker (server rack) | DD Slot#2 |
| 8 Wafer transport device | EE Slot#3 |
| 9 Wafer cassette transport device | |

(57) Abstract: Provided is a storage system useful for processing a large amount of data. When a to-be-accessed wafer cassette including a first semiconductor wafer is not connected to a slot of a host device and is stored in a wafer cassette stocker, the host device causes a wafer cassette transport device to transport and connect the to-be-accessed wafer cassette to the slot of the host device. When the to-be-accessed wafer cassette is not connected to the slot of the host device and is not stored in the wafer cassette stocker, the host device causes a wafer transport device to transport the first semiconductor

[続葉有]

京都港区虎ノ門一丁目１２番９号 スズエ
・アンド・スズエビル Tokyo (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

wafer from a wafer stocker to a cassette, causes the cassette to accommodate the first semiconductor wafer in a cassette housing, and causes the wafer cassette transport device to transport and connect, to the slot of the host device, the to be accessed wafer cassette including the first semiconductor wafer.

(57) 要約: 大量のデータの処理に有用なストレージシステムが提供される。第1半導体ウェハを含むアクセス対象のウェハカセットがホスト装置のスロットに接続されておらず、且つ、ウェハカセットストッカーに保管されている場合、ホスト装置は、ウェハカセット搬送装置に、アクセス対象のウェハカセットをホスト装置のスロットに搬送させて接続させる。アクセス対象のウェハカセットがホスト装置のスロットに接続されておらず、且つ、ウェハカセットストッカーに保管されていない場合、ホスト装置は、ウェハ搬送装置に、第1半導体ウェハをウェハストッカーからカセッターに搬送させ、カセッターに、第1半導体ウェハをカセット筐体に収容させ、ウェハカセット搬送装置に、第1半導体ウェハを含むアクセス対象のウェハカセットをホスト装置のスロットに搬送させて接続させる。